

高阻光敏 CdS 膜的制备与性质

陈智勇 计荣才 赵焕卿 章志鸣

(复旦大学物理系)

摘要——采用真空蒸发工艺,用掺杂(Cu)敏化和H₂S热处理敏化两种制备方式获得了高阻光敏CdS膜,描述了CdS膜的性质及其与制备参数的关系。

一、引言

我们采用真空热蒸发工艺制备CdS膜,这种方法的优点是容易获得大面积的均匀性良好的光导膜,但在高温下CdS容易分解,所以用常规热蒸发工艺很难制备出光敏性良好的CdS膜。热蒸发淀积膜中含有大量的S缺位,这种膜电阻率低、光敏性差。为补偿S缺位,人们采用了很多方法,主要有反应溅射法^[1]、CdS加S共蒸法^[2,3]、CdS膜在H₂S气氛中热处理法^[4]和CdS掺杂^[5]等,但在工艺上都有一定的难度。我们根据实验室的现有条件,对CdS膜进行了掺Cu和H₂S热处理两种敏化方法,都取得了较好的结果。

二、CdS的掺Cu处理

热蒸发法获得的CdS膜存在大量S缺位,这种S缺位起施主作用,因此,选择的掺杂物必须能在CdS中产生受主能级,以补偿S缺位产生的施主能级。Cu在CuS中可起受主作用,掺Cu除能提高CdS的电阻率外,还能起光敏中心的作用,可明显提高CdS光敏性。

采用分层热蒸发工艺在CdS中掺Cu,如图1所示。在钟罩中设置CdS和Cu两个蒸发源,依次在CdS膜中夹蒸一层或数层Cu膜,从而得到含Cu的CdS膜,这种膜经适当高温处理后便成为高阻光敏CdS膜。Cu的掺杂量直接决定CdS膜的暗态电阻率和光敏性,但在工艺中控制Cu的掺杂量是相当困难的。我们利用图1的装置,通过测量Cu膜的透射光强来控制Cu的掺杂量,用这种半定量方法获得的CdS膜有较好的均匀性和稳定性。

实验中采用光谱纯CdS粉末,在700°C高温下压成块状作为CdS膜的蒸发料。蒸发工艺采用的典型参量为: 真空度2~4×10⁻³Pa、基板温度150°C、蒸发温度900°C、蒸发速率0.1~0.2 μm/min。Cu的纯度为99.999%、蒸发温度约1200°C。掺Cu的CdS膜在400

本文1986年3月21日收到。

* 本文曾在1985年全国光学会上报告。

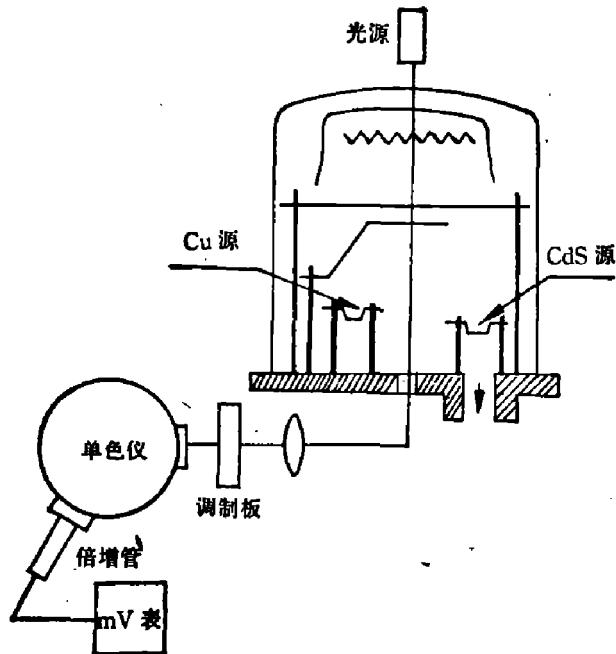


图 1 CdS 蒸发和掺杂系统

Fig. 1 Diagram of the system for evaporation of CdS and Cu-doping.

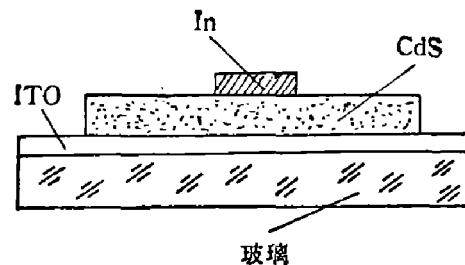


图 2 CdS 夹心层

Fig. 2 Sandwich structure of CdS film.

°C 高温下经半小时热处理，即得到适用于液晶光阀的高阻光敏 CdS 膜。

利用图 2 的结构和干涉显微镜可测量 CdS 膜的各种性能。掺 Cu 的 CdS 膜未进行高温处理前，暗态电阻率约为 $10^3 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ ，光敏性很差；高温处理后，其暗态电阻率为 $10^9 \sim 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ ，适当地控制 Cu 的掺杂量，可使它稳定在 $10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ 左右。此时光敏性有明显的增加，其暗/亮电阻比在 $10^8 \sim 10^9$ 之间（入射光强为 100 lx）。同样，适当控制 Cu 的掺杂量，暗/亮电阻比可保持在 10^3 量级。

CdS 光导膜的响应速度一般较慢，掺杂后，由于产生了大量电子陷阱，响应速度进一步减慢，并且与光强有关。表 1 表明掺 Cu CdS 膜的响应时间与光强 (He-Ne 激光) 的关系，总的来说，掺 Cu CdS 膜的响应时间在 50 ms 左右。

表 1 掺 Cu 的 CdS 膜的响应时间

Table 1 Response time of the Cu-doped CdS film.

光 强 (mW/cm^2)	上升时间 (ms)	下降时间 (ms)
1.0	20	30
0.5	35	40
0.1	60	65
0.01	>100	>100

CdS 膜的电阻变化与光强的关系是非线性的，在弱光强下有近似的线性关系，而在强光下其电阻变化趋向稳定，即电导趋向饱和。图 3 是实测 CdS 膜的光照特性曲线，由图可见，在弱光强下有较好的线性关系。

CdS 膜的本征光谱响应的峰值在 517 nm，掺 Cu 后，其光谱响应加宽，峰值位移。图 4 是掺 Cu CdS 膜的光谱响应曲线，其峰值在 540 nm 左右，已偏离本征光谱响应的峰值位置。

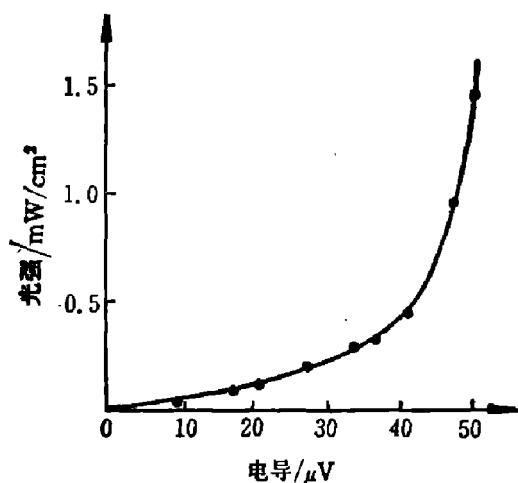


图 3 CdS 膜的光照特性

Fig. 3 Photo-electric characteristic curve of CdS film.

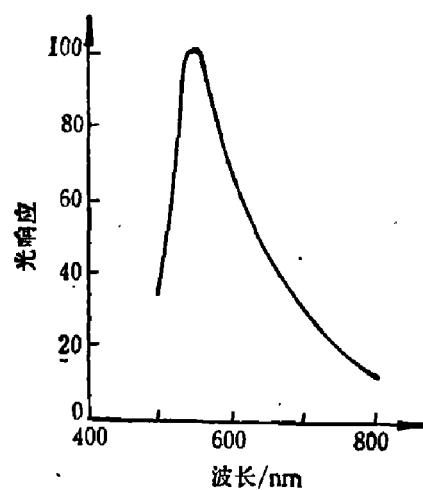


图 4 CdS 的光谱响应曲线

Fig. 4 Spectral response curve of CdS film.

三、CdS 膜的 H_2S 热处理

掺 Cu 法虽然能够明显地提高 CdS 膜的光敏性，但由于大量的杂质掺入而存在大量的电子陷阱中心，使 CdS 的光电导弛豫过程增长，延长了响应时间。

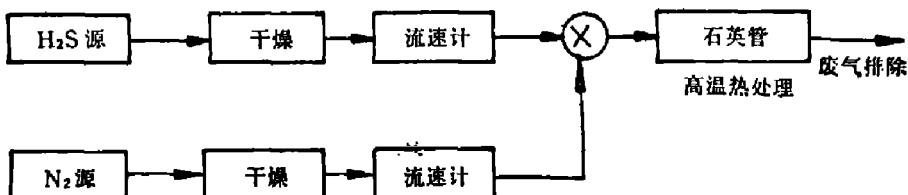


图 5 H_2S 热处理示意图

Fig. 5 The diagram of heat treatment for H_2S .

我们利用 H_2S 热处理 CdS 膜，装置如图 5 所示。将热蒸发沉积的 CdS 膜置于石英管中，加温至 500°C 左右，以高纯 N_2 作载入气体通入 H_2S 中，在高温下， H_2S 与 CdS 相互作用，发生一系列化学反应，使 CdS 膜中的 S 缺位得到补偿。其化学反应主要有两个过程：(1) $\text{H}_2\text{S} + \text{Cd} = \text{CdS} + \text{H}_2$ ，(2) $\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{S} + 4.8$ 千卡。

其中(1)是 H_2S 与 CdS 中多余的 Cd 直接反应，生成 CdS。(2)是生成的 S 直接扩散到 CdS 中以补偿 S 缺位。通过上述处理可以增加 CdS 的暗态电阻率，表 2 是典型的处理结果。

通过表 2，可以看出处理温度对结果有较大的影响。温度低于 400°C 时，电阻率增加不明显，光敏性也不好，这可能是由于温度较低时，反应过程不够充分，使 S 的缺位补偿不足。在 500°C 以上有较好的处理结果。实验中我们用 NaS 与磷酸反应生成 H_2S ，但由于这种化学反应不稳定，使 H_2S 的流速不稳定，因而处理结果不一致。在我们的实验中，处理结果最好的是 SP74 样品，其暗态电阻率为 $9.7 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ ；响应时间为上升 10 ms、下降 50 ms；暗/亮电阻比 >90 (处理参量是：温度 500°C ，时间 30 min， H_2S 流速 500 ml/min)。

由前可知，用 H_2S 热处理可补偿 CdS 中 S 的缺位，提高光敏性，但响应过程中下降时间增加，表明其中有大量的电子陷阱，也许是所用气体不纯之故。用扫描电镜观察处理后的 CdS

表 2 不同 H₂S 热处理参数对 CdS 膜光电性质的影响
Table 2 Effects of the heat-treatment parameters of H₂S on the photoelectric characteristics of CdS film.

样 品 编 号	温 度 (°C)	H ₂ S 流 速 (ml/min)	时 间 (s)	暗电阻率 (Ω·cm)	光 敏 性 (R ₀ /R _b)
SP 2	300	200~400	20	2.1×10^6	不明显
SP 7	350	200~500	25	8.0×10^6	1.2
SP 11	420	200~400	25	1.8×10^7	9
SP 25	500	300~500	20	4.3×10^8	40
SP 45	500	200~300	30	5.1×10^8	42

膜，晶粒增大，约 5 μm 左右。由于 H₂S 分解的 S 对再结晶有抑制作用，结晶效果不甚理想。

由于我们受现有实验条件的限制，未能严格稳定 H₂S 的流速和提高其纯度，在一定程度上影响了实验结果，只要改善实验条件，这种方法是可行的。

四、结 论

我们使用两种敏化法制备高阻光敏 CdS 膜。CdS 掺 Cu 的敏化效果较好，这种光敏膜已用于交流液晶光阀的研制工作。由于条件限制，CdS 的 H₂S 热处理效果不如掺 Cu 法，但实验表明这种方法是可行的。我们制备的 CdS 膜的光响应速度还达不到实用要求。

参 考 文 献

- [1] Frass D. B. et al., *J. Appl. Phys.*, **43** (1972), 3120.
- [2] Shallcross F., *R. C. A. Rev.*, **28** (1967), 569.
- [3] Beehen D., *Rev. Sci. Inst.*, **41** (1970), 1654.
- [4] Frald L. W. et al., *J. Appl. Phys.*, **46** (1975), 491.
- [5] Böer K. W., *J. Appl. Phys.*, **37** (1966), 2664.

PREPARATION AND CHARACTERISTICS OF HIGH RESISTANCE PHOTOCONDUCTOR CdS FILM

CHEN ZHIYONG, JI RONGCAI, ZAO HUANQING, ZHANG ZHIMING

(Department of Physics, Fudan University)

ABSTRACT

The work on the preparation of high resistance photoconductor CdS film by vacuum evaporation is reported. The characteristics of evaporated CdS film processed by two methods of the Cu-doping and H₂S heat-treatment are presented. The influence of preparation parameters on CdS film is described.